静電気誘導プラズマセラミックス常温成膜装置(EPD)

企業名有限会社渕田ナノ技研所在地茨城県つくば市資本金3百万円設立2004年5月従業員数5名

ナノ粒子技術、真空技術、粉のガス搬送技術、静電技術など

開発製品/技術の概要

・本件技術は、セラミックス(※)の成膜装置になる。

(※) 現状、成膜処理で実績があるセラミックスは、「アルミナ」、「イットリア」、「ジルコニア」になる。

特徴・ポイント

コア技術

- ①常温での成膜が可能
- ②膜が薄くても高い絶縁性を担保している(アルミナ膜の場合)
- ③スパッタ法よりも成膜速度が速い(成膜速度は、スパッタ法の50倍)

優位性

アルミナ膜の成膜手法として以下のような方法があるが、これら手法と比較した場合の優位性は下表の通りになる。

成膜手法	EPD装置の優位性
· · · · · ·	左記、成膜手法の場合、成膜時の基材温度は900度以上と高温になる。それに対して EPD装置では常温成膜が可能である。
スパッタ法	左記、成膜手法の場合、常温成膜が可能である。しかし、成膜速度で比較するとEPD装置の方がスパッタ法よりも50倍程度スピードが速い。また、高圧電源が必要にならない。

主な実績

実験機として20数台程度販売している。

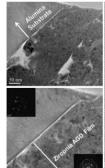
マッチング先への要望など

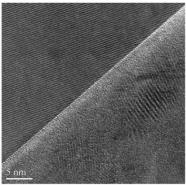
マッチング先として 希望する業種/業界

連携することで想定される利点

EPD装置を活用した事業化に関心がある企業 (真空装置の取り扱いがある企業/機械装置メーカーなど) ・現状では、EPD装置の実験機が完成している状況になる。今後、事業化に向けて量産機の開発が必要になるので、ここではEPDの量産化に向けて、共同で事業化に取り組む意向がある企業との連携を希望する。

・なお、EPD装置の量産化に成功した場合、パートナー企業は、同装置を活用した事業化が可能になる。





NEDO事業の概要

• AGD装置は、エアロゾル化ガスデポジション(AGD)を用いてジルコニア等を常温成膜する装置になる。これはセラミックス微粉をガスとともに搬送し、ノズルから噴射させて緻密な膜を常温で形成する装置になるが、成膜する原理は完成しているものの、バッチ処理のため、粉を連続して供給できないという面で課題があった。NEDO事業では、この点を改善するため、粉を連続して安定的に供給できるシステムの開発に取り組み、実験機は完成した。

本件技術に関するお問い合わせ先:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 イノベーション推進部 総括グループ TEL:044-520-5172 E-mail:nedosmpl@nedo.go.jp